Verzögerungsplatte für DUV, Lambda/4, 257 nm, 12,7 mm Durchmesser

Produkt **#29-984** **4 In Stock**

- 1 + **€482**.04

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	**€482,04** stückpreis
Stk. 6+	**€374,92** stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:
Crystalline Waveplate

Aufbau:
Air spaced; no mounting glue; no glue contacted

spacer between crystals

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):	>7
Durchmesser (mm):	12.70 +0.00/-0.25
Dicke (mm):	6.00
Aufbau:	Crystalline
Parallelität (Bogensekunden):	<3

Optische Eigenschaften

Beschichtung:	Laser V-Coat (257nm)
Designwellenlänge DWL (nm):	257
Substrat:	Crystal Quartz
Verzögerung:	λ/4
Oberflächenqualität:	10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V:	λ/10 @632.8nm
Verzögerungstoleranz:	±λ/100 @20°C
Temperaturkoeffizient (λ/°C):	0.0001
Beschichtungsspezifikation:	R<0.2% @ 257nm
Verzögerungsordnung:	0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 247:	Konform

PRODUKTDETAILS

- Für 257 und 266 nm Wellenlänge (tiefes UV)
- Ideal für Anwendungen im Vakuum
- Halterung nicht eloxiert, ohne Einsatz von Kleber

Vakuumkompatible Verzögerungsplatten für DUV sind in einer nicht eloxierten Aluminiumhalterung gefasst und frei von Klebstoffen, sodass sie ein geringes Ausgasen in Vakuumumgebungen sicherstellen. Die Verzögerungsplatten erreichen >99,8% Transmission für die Designwellenlängen 257 oder 266 nm, die Platten werden mit Verzögerungen von jeweils λ/2 oder λ/4 angeboten. Die Verzögerungsplatten haben aufgrund einer hervorragenden Verzögerungstoleranz und der nullten Ordnung eine höhere Bandbreite und eine geringere Empfindlichkeit bezüglich Temperaturänderungen. Bei den vakuumkompatiblen Verzögerungsplatten für DUV ist für eine einfache Zuordnung und Systemintegration die schnelle Achse auf der Seite der Halterung markiert. Die Verzögerungsplatten sind ideal für Einsätze im Bereich Life-Science und Lithografie, bei denen eine Vakuumumgebung benötigt wird.